

Symbol	Typ	Titel
G	Sektion	Sektion G — Physik
G01	Klasse	Messen; Prüfen
G01Q	Unterklasse	Rastersondentechniken oder Vorrichtungen hierfür; Anwendung von Rastersondentechniken, z.B. Rastersondenmikroskopie [Scanning-Probe Microscopy = SPM] [2010.01]
G01Q 10/00	Hauptgruppe	Abtastanordnungen oder Positionieranordnungen, d.h. Anordnungen zur aktiven Steuerung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]
G01Q 10/02	1-Punkt Untergruppe	. Grobes Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]
G01Q 10/04	1-Punkt Untergruppe	. Feines Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]
G01Q 10/06	2-Punkt Untergruppe	. . Schaltungen oder Algorithmen hierfür [2010.01]
G01Q 20/00	Hauptgruppe	Überwachung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]
G01Q 20/02	1-Punkt Untergruppe	. durch optische Mittel [2010.01]
G01Q 20/04	1-Punkt Untergruppe	. Selbst-detektierende Sonden, d.h. die Sonde selbst erzeugt ein für ihre Position repräsentatives Signal, z.B. piezoelektrische Sensoren [2010.01]
G01Q 30/00	Hauptgruppe	Hilfsmittel zur Unterstützung oder Verbesserung von Rastersondentechniken oder Rastersondenvorrichtungen, z.B. Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]
G01Q 30/02	1-Punkt Untergruppe	. Nicht-SPM Analyseeinrichtungen, z.B. Rasterelektronenmikroskope [Scanning Electron Microscope = SEM], Spektrometer oder optische Mikroskope [2010.01]
G01Q 30/04	1-Punkt Untergruppe	. Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]
G01Q 30/06	2-Punkt Untergruppe	. . zur Fehlerkompensation [2010.01]
G01Q 30/08	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Schaffen oder Einstellen einer gewünschten Umgebungsbedingung innerhalb einer Probenkammer [2010.01]
G01Q 30/10	2-Punkt Untergruppe	. . thermische Umgebung [2010.01]
G01Q 30/12	2-Punkt Untergruppe	. . fluide Umgebung [2010.01]
G01Q 30/14	3-Punkt Untergruppe	. . . flüssige Umgebung [2010.01]
G01Q 30/16	2-Punkt Untergruppe	. . Vakuumumgebung [2010.01]
G01Q 30/18	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Schützen oder Isolieren des Inneren einer Probenkammer vor äußeren Umgebungsbedingungen oder Umgebungseinflüssen, z.B. Schwingungen oder elektromagnetischen Feldern [2010.01]
G01Q 30/20	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen oder Verfahren für die Probenhandhabung [2010.01]
G01Q 40/00	Hauptgruppe	Kalibrierung, z.B. von Sonden [2010.01]
G01Q 40/02	1-Punkt Untergruppe	. Kalibrierstandards und Verfahren zu deren Herstellung [2010.01]
G01Q 60/00	Hauptgruppe	Besondere Arten der Rastersondenmikroskopie [SPM] oder Vorrichtungen hierfür; wesentliche Bestandteile hiervon [2010.01]
G01Q 60/02	1-Punkt Untergruppe	. Kombinierte SPM-Methoden, die zwei oder mehr SPM-Techniken umfassen [2010.01]
G01Q 60/04	2-Punkt Untergruppe	. . Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]
G01Q 60/06	2-Punkt Untergruppe	. . optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-field Optical Microscopy = SNOM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]

Symbol	Typ	Titel
G01Q 60/08	2-Punkt Untergruppe	. . Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]
G01Q 60/10	1-Punkt Untergruppe	. Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. STM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/12	2-Punkt Untergruppe	. . Rastertunnel-Spektroskopie [Scanning Tunnelling Spectroscopy = STS] [2010.01]
G01Q 60/14	2-Punkt Untergruppe	. . Rastertunnel-Potentiometrie [Scanning Tunnelling Potentiometry = STP] [2010.01]
G01Q 60/16	2-Punkt Untergruppe	. . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]
G01Q 60/18	1-Punkt Untergruppe	. optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-Field Optical Microscopy = SNOM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SNOM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/20	2-Punkt Untergruppe	. . Fluoreszenz [2010.01]
G01Q 60/22	2-Punkt Untergruppe	. . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]
G01Q 60/24	1-Punkt Untergruppe	. Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. AFM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/26	2-Punkt Untergruppe	. . Reibungskraft-Mikroskopie [2010.01]
G01Q 60/28	2-Punkt Untergruppe	. . Adhäsionskraft-Mikroskopie [2010.01]
G01Q 60/30	2-Punkt Untergruppe	. . Potential-Rastermikroskopie [2010.01]
G01Q 60/32	2-Punkt Untergruppe	. . AC-Modus [2010.01]
G01Q 60/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Tapping-Modus [2010.01]
G01Q 60/36	2-Punkt Untergruppe	. . DC-Modus [2010.01]
G01Q 60/38	2-Punkt Untergruppe	. . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]
G01Q 60/40	3-Punkt Untergruppe	. . . Leitfähige Sonden [2010.01]
G01Q 60/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Funktionalisierung [2010.01]
G01Q 60/44	1-Punkt Untergruppe	. Ionenleitfähigkeits-Rastermikroskopie [Scanning Ion-Conductance Microscopy = SICM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SICM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/46	1-Punkt Untergruppe	. Kapazitätsrastermikroskopie [Scanning Capacitance Microscopy = SCM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SCM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/48	2-Punkt Untergruppe	. . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]
G01Q 60/50	1-Punkt Untergruppe	. Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. MFM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/52	2-Punkt Untergruppe	. . Resonanz [2010.01]
G01Q 60/54	2-Punkt Untergruppe	. . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]
G01Q 60/56	3-Punkt Untergruppe	. . . Sonden mit magnetischer Beschichtung [2010.01]
G01Q 60/58	1-Punkt Untergruppe	. thermische Rastermikroskopie [Scanning Thermal Microscopy = SThM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SThM-Sonden [2010.01]
G01Q 60/60	1-Punkt Untergruppe	. elektrochemische Rastermikroskopie [Scanning Electro-Chemical Microscopy = SECM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SECM-Sonden [2010.01]
G01Q 70/00	Hauptgruppe	Allgemeine Aspekte zu SPM-Sonden, deren Herstellung und zugehörigen Geräten, sofern sie nicht besonders für eine einzelne der SPM-Techniken unter G01Q 60/00 ausgebildet sind [2010.01]

Symbol	Typ	Titel
G01Q 70/02	1-Punkt Untergruppe	. Sondenhalterungen [2010.01]
G01Q 70/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kompensation für temperatur- oder schwingungsinduzierte Fehler [2010.01]
G01Q 70/06	1-Punkt Untergruppe	. Arrays von Sondenspitzen [2010.01]
G01Q 70/08	1-Punkt Untergruppe	. Sondencharakteristik [2010.01]
G01Q 70/10	2-Punkt Untergruppe	. . Form und Konizität [2010.01]
G01Q 70/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Nanoröhrchen-Spitzen [2010.01]
G01Q 70/14	2-Punkt Untergruppe	. . besondere Materialien [2010.01]
G01Q 70/16	1-Punkt Untergruppe	. Sondenherstellung [2010.01]
G01Q 70/18	2-Punkt Untergruppe	. . Funktionalisierung [2010.01]
G01Q 80/00	Hauptgruppe	Anwendungen von anderen Rastersondentechniken als SPM (Herstellung oder Behandlung von Mikrostrukturen B81C; Herstellung oder Behandlung von Nanostrukturen B82B 3/00; Aufzeichnen oder Wiedergabe von Information mittels Nahfeldwechselwirkung G11B 9/12, G11B 11/24 oder G11B 13/08) [2010.01]
G01Q 90/00	Hauptgruppe	Rastersondentechniken und Rastersondenvorrichtungen soweit nicht anderweitig vorgesehen [2010.01]